芯片大厂争先布局Wi-Fi7

本报记者 陈炳欣



技术迭代加快,大厂争相进入Wi-Fi7市场

在纳入Multi-RU、Multi-Link及增强MU-MIMO等技术之后,Wi-Fi7的数据最大传输速率将达5.8Gbps。

如果从IEEE于1997年推出第一代802.11协议算起,Wi-Fi已经发展了20多年,从常见的桌面终端、移动终端、家用电器到汽车,随处可见Wi-Fi的身影。Global Market Insights的数据显示,2021年全球Wi-Fi芯片市场规模超过200亿美元。

这些年来,Wi-Fi也在不断更新迭代,第七代Wi-Fi标准规范802.11be预计将于2022年年底发布。在纳入Multi-RU、Multi-Link以及增强MU-MIMO等新技术之后,Wi-Fi的数据最大传输速率从

第一代的2Mbps,将增长到第七代的5.8Gbps。

Wi-Fi的快速发展吸引了通信芯片厂商的高度重视。2022年以来,全球前三大Wi-Fi芯片供商博通、高通、联发科先后均发布了Wi-Fi 7芯片平台或者展示了相关技术方案。今年1月,联发科率先进行全球首个Wi-Fi 7现场演示,5月份又发布两款Wi-Fi 7芯片,分别是面向路由和网关市场的Filogic 880与面向手机、平板、笔记本、机顶盒等设备的Filogic 380。联发科副总经理暨智能连接

事业部总经理许皓钧表示: "Wi-Fi 7的推出标志着Wi-Fi可以真正替代高带宽的有线、以太网技术,将为家用、商用和工业网络提供强大的网络能力。"

高通在2月份举行的MWC2022上推出Wi-Fi7与蓝牙结合的解决方案FastConnect7800,支持2.4GHz、5GHz、6GHz三大频段,峰值速率达到5.8Gbps,时延低于2ms,功耗比上一代减少50%。在近日召开的IFA 2022上,高通再次演示了Wi-Fi7的重要特性——320MHz信道的高频并发

(HBS)多连接技术,为跨频段与频道传输、减少多用户联机时产生的延迟现象提供解决方案。

博通在 4 月份推出旗下首款 Wi-Fi 7芯片后,又陆续推出多款组合性产品,包括面向消费电子市场的 BCM6726和 BCM67263,面向企业级市场的 BCM43740和 BCM73720,以及面向移动设备市场的 BCM4398。其中 BCM6726可支持2.4GHz、5GHz和6GHz频段。

英特尔也于日前表示正在开发 Wi-Fi 7芯片,相关产品将于2024 年安装在笔记本电脑等产品之中。

不同于高通、联发科推行的

通信芯片大厂之所以加快开发 Wi-Fi 7芯片,显然是缘于元宇宙、 自动驾驶、AIoT等新应用的拉动。

面向智能设备与路由接入,策略各有不同

通信芯片大厂之所以加快开发 Wi-Fi 7芯片,显然是缘于元宇宙、 自动驾驶、AIoT等新应用的拉动, 业界目前普遍看好这些对高速连接 与低时延有更高要求的新型应用的 未来市场前景。头部 Wi-Fi 芯片厂 商希望能够抢夺先机,布局未来的 蓝海。高通技术公司技术规划高级 总监 Andrew Davidson 指出,基于 Wi-Fi 7在时延、速度和容量等方 面的优化组合,将成为扩展现实 (XR)、元宇宙、游戏和边缘计算等 前沿应用场景的核心。IDC全球半 导体研究副总裁 Mario Morales 也 表示,更快的宽带网络接入、更高分 辨率的视频流媒体应用和VR游戏 正在驱动市场对Wi-Fi 6、Wi-Fi

6E和Wi-Fi 7的需求。

从策略上看,高通与联发科更 加注重手机、XR、元宇宙等智能设 备的无线连接领域,以此切入市 场。在近日召开的IFA 2022上,高 通首次公开演示新一代Wi-Fi 7标 准的重要特性——320MHz信道的 高频并发(HBS)多连接技术。所谓 高频并发多连接技术是指Wi-Fi 7 可以支持 2.4GHz、5GHz、6GHz 三 大频段, Wi-Fi设备在切换不同的 频段时需要一定的切换时间,对网 络系统造成延迟。这对那些对延迟 敏感的应用,如无线XR装置、实时 多人高清联机游戏、元宇宙等必将 造成困扰。而高频并发多连接则可 以让Wi-Fi设备通过不同的频段与 频道同时传送并接收数据,提升传输速度,减少延迟,对于那些急需新应用打开市场的智能设备来说,绝对是一大助力。

联发科今年1月率先进行的Filogic Wi-Fi 7无线连接平台技术演示,也将重点放在为多人AR/VR应用、云游戏、4K视频通话和8K流媒体等应用提供无缝连接。这些也都是智能设备未来的热点应用,是拉动相关产品销售的关键。Mario Morales表示,Wi-Fi 7增强了带宽、多链路操作(MLO)等新功能,对智能手机、个人电脑、消费类电子等领域具有很大的吸引力,服务提供商可以开始在这些细分市场进行更广泛的部署。

Wi-Fi 芯片与处理器 SoC 芯片集 成化策略,博通采用了差异化的 竞争策略,一方面采取单芯片的 策略主打高端市场。高通和联发 科的Wi-Fi芯片主要面向众多手 机厂商,博通的大客户则是苹果 公司。因而其在推出面向消费电 子市场的 BCM6726 支持 2.4GHz、 5GHz和6GHz频段的同时,也推 出 BCM67263 仅支持 6GHz 频段, 以应对大客户的灵活应用。另一 方面,博通也十分重视零售和工业 等垂直行业市场,推出用于企业 产品的 BCM43740 和 BCM73720 等,抢占路由器等物联网接入产 品市场。

按照此前的规划时程, Wi-Fi 7标准将于2022年年底正式发布, 其芯片平台也将逐渐走向商用。

商用之路逐渐开启,本土厂商迎机遇

按照此前的规划时程,Wi-Fi 7标准将于2022年年底正式发布。届时将有越来越多新品被推出,Wi-Fi 7的芯片平台也将逐渐走向商用。对此,博通无线连接部门副总裁Vijay Nagarajan表示:"生态系统已经准备好了,Wi-Fi 7将带来非凡的容量和惊人的速度,进一步

扩展千兆宽带。"

根据市调机构 Yole 预测, 2024年 Wi-Fi 7将在市场上铺货,到2026年 Wi-Fi 6E的市场份额有望超越 Wi-Fi 6成为主流的规格,Wi-Fi 7的比例则会从2024年的3%提升到8%。但从当前的市场份额来看,国内厂商仍以 Wi-Fi 5的

量产为主,Wi-Fi芯片市场仍被通信芯片大厂所主导。

赛迪顾问集成电路中心总经理 滕冉指出,Wi-Fi 7芯片包括SoC 和射频前端,前者属于数模混合 CMOS芯片,后者属于特殊工艺。 Wi-Fi 7芯片的难点在于在IP成熟 度、Wi-Fi兼容性,以及应用场景中 的性能优化经验等方面。"这对所有 Wi-Fi厂商都将带来成本、产品成 熟度、市场策略等方面带来挑战,本 土厂商也不例外。"滕冉表示。

不过即将到来的Wi-Fi 7势必 又将为本土厂商带来的新机遇,当 下本土厂商要做的就是技术沉淀, 这样才能把机遇紧紧握在手里。

2022年全球晶圆厂设备预计支出近千亿美元

本报讯 当地时间9月27日, SEMI发布了最新一个季度的世界 晶圆厂预测报告,推测本年度全球 前端晶圆厂的设备支出将同比增长 约9%,达到990亿美元的历史新 高。此外,SEMI总裁兼CEO Ajit Manocha表示:"在2022年达到创 纪录的水平后,预计明年的设备市 场会在新晶圆厂和升级需求的推动 下保持健康增长。"

SEMI预计,中国台湾地区将引领本年度的晶圆厂设备支出,同比

增长47%,至300亿美元。同时中国 大陆地区为220亿美元,较去年峰值 下滑11.7%。其次韩国下滑5.5%,至 222亿美元,但预计欧洲/中东地区 的支出将达到创纪录的66亿美元, 尽管绝对支出金额仍低于其他地 区,但同比增长却高达141%。

SEMI指出,对高性能计算(HPC)等先进技术的强劲需求,正在大力推动欧洲/中东地区的支出激增,此外预计美洲和东南亚也将在2023年获得创纪录的高投资。

SEMI世界晶圆厂预测报告显示,继2021年增长7.4%之后,2022年全球产能增长还将努力向8%迈进(达到7.7%)。

上一次出现这样的同比增长率,要追溯到2010年——当时200mm晶圆当量的月产能超过了1600万片,约为2023年预估月产能2900万片的一半。

到 2022年,167家晶圆厂和生产线的产能增长,将占设备支出的84%以上。不过随着 129家已知晶

圆厂和生产线的产能增加,预计明年这一数字将回落至79%。

不出所料的是,代工行业仍占 2022~2023 年设备支出的大头 (53%),其次是存储(2022年、2023 年分别占32%和33%),它们也是业内产能增幅的前两名。

最后,SEMI在9月更新的全球 晶圆厂预测报告中,列出了1453处 设施、生产线,其中包括即将于2022 年内或不久后开始投入生产的148 处量产设施、生产线。 (新文)

EUV 光刻机走到尽头?

本报记者 许子皓

近日,全球最大的光刻机设备 供应商荷兰阿斯麦(ASML)的首席 技术官 Martin van den Brink 表 示,目前ASML正在有序地推行着 此前制定的路线图,之后EUV技术 将升级为High-NA EUV技术,准 备在明年向客户交付首台 High-NA EUV 光刻机。但对于 High-NA技术之后的Hyper-NA, Martin van den Brink对其持怀疑 态度,因为技术难度的大幅提升,导 致制造和使用成本都高得惊人,且 不一定能真正投入生产。受此约 束, Martin van den Brink 指出: "High-NA 技术很可能成为 EUV 光刻技术的终点,半导体光刻技术 之路已走到尽头。"

新一代High-NA EUV 光刻机将于明年交付

长久以来,EUV光刻机都是先进制程得以延续的必备设备,作为全球第一大光刻机设备商,同时也是全球唯一可提供EUV光刻机的设备商,ASML承接的各大半导体厂商的订单堆积成山。因此,去年ASML就已经提高了两次生产目标,希望到2025年,年出货量能达到约600台DUV(深紫外光)光刻机以及90台EUV(极紫外光)光刻机。所以,在市调机构CINNO Research发布的2022年上半年全球上市公司半导体设备业务营收排名Top10报告中,ASML排名第二

EUV 光刻技术方面,按照 ASML 此前制定的路线图,之后 EUV 技术将升级为 High-NA EUV 技术。据 Martin van den Brink介绍,开发 High-NA EUV 技术的最大挑战在于,为 EUV 光学器件构建计量工具,所配备的反射镜尺寸为前一代的两倍,需要将其平整度控制在20皮米以内。此外,还需要在一个"可以容纳半个公司"的真空容器内进行验证,该容器位于蔡司公司,ASML预计将于明年拿到第一个镜头。

相较于配备了0.33数值孔径透镜的EUV系统,High-NAEUV光刻系统将提供0.55数值孔径,精度将更高,可以实现更高分辨率的图案化,以及更小的晶体管特征。预计明年ASML将向客户交付首台High-NAEUV光刻机。交付后,EUV光刻机将不再是最先进的设备,理论上就能够实现自由出货。

合积电负责研发和技术的高级 副总裁Y.J.Mii博士此前透露,合积电将在2024年购买ASML的High-NAEUV光刻机,目标是在2025年量产2纳米制程工艺。

英特尔同样也已下单,谁将拿到第一台 High-NA EUV 光刻机还是个悬念。

售价和耗电量 将进一步提升

虽然 High-NA EUV 光刻机 的强大性能可以将先进制程推往下 一阶段,但其也使成本大幅增长。

首先就是售价,全新一代 High-NA EUV光刻机的售价预计 将超过3亿美元,是传统EUV光 刻机售价的3倍左右,这意味着台 积电等各大厂商的设备成本将再次 提升。

其次是耗电量,EUV光刻机本就是耗电大户,而由于High-NA EUV光刻机对于光源的需求大幅提升,耗电量也将从1.5兆瓦提升到2兆瓦。此外,还需要使用水冷铜线为其供电。

台积电目前已经安装了超80台EUV光刻机,此前就因不堪电费的重负,已经关闭了4台EUV光刻机。他们还计划在2023年上调先进工艺的代工价格,以减轻财务负担。

这也是 Martin van den Brink 不看好再下一代 EUV 光刻技术 ——Hyper-NA EUV 的根本原因, 虽然理论上 Hyper-NA EUV 光刻 可以提供0.75 左右的数值孔径,但 因其技术难度将大幅提升,导致其 制造和使用成本都高得惊人,且不 一定能真正投入生产,性价比基本 没有。

所以受此约束,Martin van den Brink更是大胆预测:"如果成本控制问题解决不了,High-NA技术很可能成为EUV光刻技术的终点,半导体光刻技术之路就将走到尽头。"

北京半导体行业协会副秘书长 朱晶表示,未来更先进的制程工艺 很可能没有大规模的增量市场进行 支撑了,如手机、PC和数据中心等 市场的增量规模,已经无法支撑 Hyper-NA EUV光刻机的巨量研 发投入。另外,能源消耗量也无法 承担,除非元宇宙、区块链这些新场 景的渗透率快速提升,对先进工艺 的需求增量快速增加,不然, High-NA光刻技术就将是EUV光 刻的结局了。

EUV 光刻统治地位不保 新技术更具潜力

随着 EUV 光刻机所暴露的问题越来越多,更多的企业和大学都在想方设法绕道而行,目前已经有多项技术脱颖而出。

9月21日,美国原子级精密制造工具的纳米技术公司Zyvex Labs发布公告,已推出世界上最高分辨率的光刻系统"ZyvexLitho1",其基于STM扫描隧道显微镜,使用的是EBL电子束光刻方式,可以制造出0.7纳米线宽的芯片,相当于2个硅原子的宽度,是当前制造精度最高的光刻系统。

据悉, ZyvexLitho1 光刻系统的高精度光刻可以用于实验室阶段高端制程工艺的产品研发, 是传统芯片制造所需光刻机的一个应用补充, 主要可用于制造对于精度有较高要求的量子计算机的相关芯片, 例如高精度的固态量子器件、纳米器件及材料, 对半导体产业的发展具有巨大的促进作用。目前, Zyvex Labs已经开始接受订单,据悉,6个月内就可出货。

对于这个新型光刻系统是否

会威胁到 EUV 光刻的统治地位, 赛迪顾问集成电路产业研究中心 一级咨询专家池宪念表示:"短期 内并不会。"池宪念认为 Zyvex-Litho1 是一种使用电子束曝光作 为光刻方式的设备,与传统光刻机 工作原理会有明显的差异。它是 通过电子束改变光刻胶的溶解度, 最后选择性地去除曝光或未曝光 区域。它的优势在于可以绘制10 纳米以下分辨率的自定义图案,属 于无掩模光刻直接写入的工作方 式,精度远高于目前的传统光刻 机。但是由于这类设备的单个产 品光刻的工作时间要在几小时到 十几小时不等,工作效率方面还需 进一步提高,因此不会快速取代 EUV光刻机。

此外,还有多电子東直写光刻机(MEB)、定向自组装技术(DSA)以及纳米压印技术(NIL)等技术作为候选。其中,MEB被广泛应用于掩膜的制造,分辨率可达到2纳米,未来将被用于在晶圆上直接刻画图形而不借助掩膜版。DSA则利用两种聚合物材料的定向生长进行加工,对于材料的控制要求高,生长缺陷大,目前还不能真正用于生产,但可兼顾分辨率极高的加工速度需求。

NIL技术也被视为是最佳替代方案。据了解,NIL技术(纳米压印微影技术)是在一个特殊的"印章"上先刻上纳米电路图案,然后再将电路图案"压印"在晶圆上,就像盖章一样。由于没有镜头,NIL技术比EUV要省钱得多。根据佳能等厂商发布的消息,NIL的耗电量可压低至EUV生产方式的10%,设备投资也将降低至40%。

日本的半导体厂商铠侠从 2017年就开始与佳能等半导体企业合作,研发NIL的量产技术,且已成功掌握15纳米量产技术,目前正在进行15纳米以下技术研发,预计2025年将达成,精度可达5纳米。

社长:张立 社址:北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦18层 邮编:100048 每周二、五出版 周二8版 周五8版 零售4.50元 全年定价420元 广告部:010-88558848/8808 发行部:010-88558777 广告许可证:京石工商广登字20170003号 发行单位:中国电子报社 印刷单位及地址:经济日报印刷厂 北京市西城区白纸坊东街2号